(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2025 年 11 月 20 日 (20.11.2025)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2025/236769 A1

(51) 国际专利分类号:
B24B 37/005 (2012.01) *B24B 53/017* (2012.01)
B24B 49/16 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2025/076270

(22) 国际申请日: 2025 年 2 月 7 日 (07.02.2025)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202410615183.1 2024年5月17日 (17.05.2024) CN

(71) 申请人:杭州众硅电子科技有限公司(**HANGZHOU SIZONE ELECTRONIC TECHNOLOGY INC.**) [CN/CN]; 中国浙江省杭州市临安区青山湖街道创业街88号1幢一层 311300 (CN)。

(72) 发明人:顾海洋(**GU, Haiyang**); 中国浙江省杭州市临安区青山湖街道创业街88号1幢一层 311300 (CN)。喻康(**YU, Kang**); 中国浙江省杭州市临安区青山湖街道创业街88号1幢一层 311300 (CN)。杨渊思(**YANG, Yuansi**); 中国浙江省杭州市临安区青山湖街道创业街88号1幢一层 311300 (CN)。

(74) 代理人: 杭州凯知专利代理事务所（普通合伙）(**HANGZHOU KAIZHI PATENT AGENCY (GENERAL PARTNERSHIP)**); 中国浙江省杭州市余杭区南苑街道迎宾同济中心 1 幢 403-4室 311199 (CN)。

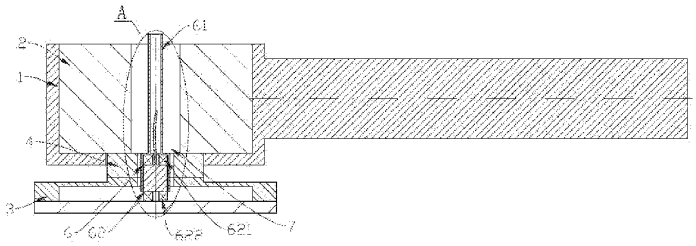
(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚

(54) **Title:** CONDITIONING DEVICE WITH PRESSURE DETECTION

(54) 发明名称: 一种带有压力检测的修整装置

[图1]



(57) **Abstract:** A conditioning device with pressure detection, comprising: a conditioner driving unit (2); a conditioner execution unit (3), wherein the conditioner execution unit (3) is connected to the conditioner driving unit (2) by means of an output shaft (4) and can be driven by the conditioner driving unit (2) to circumferentially rotate about its own axis, and the conditioner execution unit (3) can be moved by a conditioner base (1) to generate an axial downward pressure; a sensor (5); and a dynamic force transmission unit (6), which is arranged between the sensor (5) and the conditioner execution unit (3), at least partially cooperates with the sensor (5) for mounting and positioning of the sensor (5), and is at least partially in contact with both the conditioner execution unit (3) and the sensor (5), so as to transmit the axial pressure of the conditioner execution unit (3) to the sensor (5) while maintaining the relatively stationary state of the sensor (5). By means of the provision of the dynamic force transmission unit (6), the rotation of the conditioner execution unit (3) and the downward pressing of the conditioner execution unit (3) on a polishing pad are separated independently, thereby ensuring that the sensor (5) can accurately feed back the downward pressure.

WO 2025/236769 A1

[见续页]

(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:
— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(57) 摘要: 一种带有压力检测的修整装置，包括：修整器驱动单元（2）；修整器执行单元（3），通过输出轴（4）与修整器驱动单元（2）连接，在修整器驱动单元（2）的驱动下可绕着自身轴线周向旋转，且修整器执行单元（2）在修整器底座（1）的带动下可产生轴向下压力；传感器（5）；动态力传导单元（6），设于传感器（5）和修整器执行单元（3）之间，其至少部分与传感器（5）配合，用于传感器（5）的安装定位，且至少部分分别与修整器执行单元（3）和传感器（5）相接触，以将修整器执行单元（3）的轴向压力传递至传感器（5），且保持传感器（5）的相对静止状态。通过动态力传导单元（6）的设置，将修整器执行单元（3）的旋转和修整器执行单元（3）对抛光垫的下压两个动作相对独立开来，确保了传感器（5）能准确反馈下压力。